

Catalogue des stages entreprises et de la formation continue en journée

Approfondissement en imagerie au MEB et en microanalyse X

Présentation

Approfondissement des connaissances théoriques et pratiques en imagerie au microscope électronique à balayage et en microanalyse X quantitative

Stage de 4,5 jours.

Nombre maximum de stagiaires : 10

Responsable

François Brisset, Ingénieur de recherches, Université Paris-Sud.

Organisé en collaboration avec le centre des matériaux de l'ENMSP.

Avec la collaboration de spécialistes des centres de recherche des organismes suivants : Arcelor, EDF, Centre des Matériaux de l'ENSMP, ONERA, BRGM, Université d'Artois.

Public, conditions d'accès et prérequis

Toute personne devant utiliser régulièrement un MEB et un système de microanalyse EDS (et/ou WDS) et en ayant déjà utilisé un MEB et un EDS (ou un WDS).

Prérequis

Le suivi de ce stage suppose une expérience pratique professionnelle dans le domaine de l'observation des matériaux solides par microscopie électronique à balayage et à la microanalyse EDS (ou WDS) correspondant aux acquis du niveau du stage : "[Introduction à la microscopie électronique à balayage](#)" (FCEA01)

Objectifs

Objectifs pédagogiques

- Préciser et approfondir les connaissances nécessaires à un travail efficace sur les MEBs et à une interprétation meilleure des résultats d'analyse X,
- Étudier les divers phénomènes physiques rencontrés lors des interactions entre un faisceau électronique et la matière,
- Rechercher les conditions optimales d'observation de ses propres échantillons,
- Approfondir la théorie et la pratique de la microanalyse X quantitative sur massif ou stratifiés,
- Améliorer sa maîtrise de la qualité de l'imagerie électronique et de l'analyse X,
- Savoir identifier des problèmes liés aux équipements.

Compétences visées

Comprendre ses images et ses microanalyses,
Connaître les phénomènes physiques, les utiliser à bon escient,
Résoudre les problèmes éventuels et maîtriser ces images et microanalyses.

Les + du stage

Atout 1 : Les bases théoriques révisées et avec un accent sur la microanalyse X quantitative,
Atout 2 : Une journée de travail sur les équipements avec des utilisateurs expérimentés,
Atout 3 : De nouvelles notions sur les systèmes d'analyses WDS et EBSD et du travail sur les matériaux polymères,
Atout 4: A la fin, une révision de tous les points importants et vus durant la semaine à l'aide d'un quiz.

Enquête de satisfaction

Cnam Entreprises étant dans une démarche d'amélioration continue, une enquête de satisfaction devra être complétée à la fin de la formation par chacun des stagiaires. Dans le cas d'un cursus, chaque unité d'enseignement (UE) sera évaluée individuellement.

Voir aussi les formations en

[Analyse des matériaux](#)

Programme

Programme

Jour 1 : Accueil après-midi

Jour 2 : Rappel sur les bases - interactions, MEB et analyse X quantitative,

Jour 3 : Analyse X – WDS et travail sur les polymères,

Jour 4 : Journée entière sur les appareils, mise en pratique des notions théoriques,

Jour 5 : Notions sur l'analyse EBSD, les erreurs possibles en analyse X, la métallisation et la maintenance des équipements.

Moyens pédagogiques

Une journée entière sur les appareils MEB et EDS pour mettre en valeur les connaissances théoriques vues auparavant en salle lors de cours participatifs.

Informations pratiques

Contact

Posez-nous vos questions via [ce formulaire \(cliquer ici\)](#) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Centre(s) d'enseignement

[Cnam Entreprises Paris](#)

Complément lieu

Paris 3^{ème}

1 journée de travaux dirigés au Centre des Matériaux ENSMP (Evry)

Déjeuners inclus

Session(s)

du 24 mars 2025 au 28 mars 2025

24/03/2025 25/03/2025 26/03/2025 27/03/2025 28/03/2025

Une journée de travail sur les microscopes et la microanalyse. Les autres jours en salle.

Code Stage : FCEA02

Tarifs

2 625 €

Individuels : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?

[Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation](#)

Nombre d'heures

25

24 mars 2025 - 28 mars 2025

Avis sur la formation



Dates du stage

Du 25 au 29 mars 2024

Horaires

9h – 17h

Une question ?

Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72

*Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00*

Votre inscription

2 possibilités :

S'inscrire en ligne

[Bulletin d'inscription à télécharger](#)
et à renvoyer par courrier à :

Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris

ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net

```
/**/ a.customlink:hover, a.customlink, a.customlink:visited { text-decoration: none; } a.customlink:visited, .button:active  
a.customlink { color: #857761; } .button:hover a.customlink { color: #333333; } /**/
```

MISSION HANDI'CNAM

[Aider les auditeurs en situation de handicap](#)

<https://formation-entreprises.cnam.fr/approfondissement-en-imagerie-au-meb-et-en-microanalyse-x-897038.kjsp?RH=>